

액체 기화기 포함 슬라이드 Pecvd 튜브 가열로 Pecvd 장비

품목 번호: KT-PE12



소개

KINTEK 슬라이드 PECVD 튜브 가열로: RF 플라즈마, 급속 열 사이클링 및 맞춤형 가스 제어 기능을 갖춘 정밀 박막 증착 시스템입니다. 반도체 및 태양 전지에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

가열로 모델	KT-PE12-60
최고 온도	1200°C
상시 작동 온도	1100°C
가열로 튜브 재질	고순도 석영
가열로 튜브 직경	60mm
가열 구역 길이	1x450mm
챔버 재질	일본산 알루미늄 파이버
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일
가열 속도	0-20°C/min
열전대	내장 K 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
슬라이딩 거리	600mm
RF 플라즈마 장치	
출력 전력	5 -500W 조절 가능 (± 1% 안정도)
RF 주파수	13.56 MHz ±0.005% 안정도
반사 전력	최대 350W
매칭	자동
소음	
냉각	공랭식
가스 정밀 제어 장치	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4 채널

유량	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
선형성	±0.5% F.S.
반복성	±0.2% F.S.
파이프라인 및 밸브	스테인리스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa
유량계 컨트롤러	디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러
표준 진공 장치(선택 사항)	
진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프
펌프 유량	4L/S
진공 흡입 포트	KF25
진공 게이지	피라니/저항 실리콘 진공 게이지
정격 진공 압력	10Pa
고진공 장치(선택 사항)	
진공 펌프	로터리 베인 펌프 + 분자 펌프
펌프 유량	4L/S + 110L/S
진공 흡입 포트	KF25
진공 게이지	복합 진공 게이지
정격 진공 압력	6x10-4Pa

위의 사양 및 설정은 맞춤화할 수 있습니다.

번호	설명	수량
1	가열로	1
2	석영 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 단열 블록	2
5	튜브 단열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	RF 플라즈마 소스	1
8	정밀 가스 제어 장치	1
9	진공 장치	1
10	사용 설명서	1